



氏名	田中 正治 (たなか しょうじ)
生年	1954年

## 専門分野

- ・ 機械：真空技術一般、真空装置の設計、真空利用プロセス(表面改質、薄膜)技術指導
- ・ エネルギー：燃料電池、リチウムイオン電池の電極材料開発支援
- ・ 電気・電子：電子デバイス用薄膜技術(スパッタリング、CVD)の装置技術指導
- ・ 金属：金属表面技術(薄膜・改質)の開発支援(プロセス技術、装置技術)

## 資格等

【資格】技術士(応用理学部門、金属部門、総合技術監理部門)

## 主な経歴

- ・ 東京理科大学 理学部応用物理学科 卒業、同大学院 理学研究科 物理学専攻修了
- ・ 日本真空技術株式会社(現 株式会社アルバック)入社
- ・ 株式会社リコーに入社後、研究開発本部 中央研究所、環境技術研究所、先端技術研究所等の研究部門において、真空・薄膜技術、プラズマ技術、複写機、燃料電池技術等の技術開発に従事
- ・ 長岡技術科学大学にて、産学連携研究員(有期雇用研究職員)電池技術の研究支援に従事
- ・ 技術調査会社と業務委託契約を締結し、東京工業大学において量子技術の研究支援業務に従事

## 現在

## 支援実績

(1)2015年4月～2019年3月 国立大学法人長岡技術科学大学 電気化学エネルギー変換材料研究室(梅田研究室)において、リチウムイオン電池用金属セパレーターの耐食向上表面処理の研究、電池電極の電気化学反応解析技術等の研究支援に従事。

(2)2020年1月～2021年11月 国立大学法人東京工業大学 工学院電気電子系波多野研究室において、量子技術研究の支援業務に従事し量子センサー等のデバイス技術にかかわるCVD、スパッタリング等の薄膜技術、真空装置技術、研究設備安全技術・安全管理等の研究支援業務を実施。

## 自己PR

真空技術、質量分析をベースに基礎科学や産業応用のデバイスプロセスへの応用に長年従事してきました。それまでの真空・ドライプロセスを利用する材料研究や分析技術を専門としてきた中で、大学において燃料電池の開発を経験してきた結果、電池等の溶液系の電気化学デバイスにおいてもスパッタリング等の薄膜技術や質量分析等の分析技術が重要なことを認識したので経験してきた技術の応用範囲を広げたいと思います。

大学においてはさらに、最先端の量子技術に関わるCVD等の薄膜作製の研究支援を経験して、先端デバイス研究においては高品質な薄膜技術、プロセス制御技術の重要性を再認識しました。技術開発や研究に邁進される企業、組織において引き続き真空、薄膜、表面処理等のプロセス設計、プロセス技術の向上に資するお手伝いができればと思います。